

# IMF시대의 특허관리전략

## 공개기보제도등의 활용을 통한 기술대국으로의 재도약

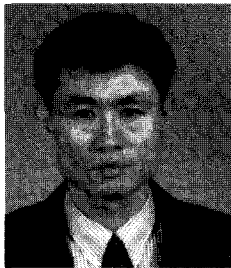
우리나라의 산업재산권 출원 건수는 매년 높은 비율로 증가하여 세계 제5위의 출원대국으로 부상하였지만 출원내용을 보면 아직도 선진국과 기술수준의 격차가 크다는 것을 인정하지 않을 수 없다. IMF체제는 우리나라의 경제, 사회 모든 분야에 있어서 거품을 제거하고 내실있는 성장을 요구하고 있다.

이러한 시대적 요청에 부응하기 위해 특허청은 올해 7월부터 기업의 특허관리 비용을 절감하고 우수한 출원을 유도하기 위해 공개기보제도를 시행하고 있다. 대기업 뿐만 아니라 중소기업의 적극적인 참여가 요망된다.

IMF 시대의 주요한 특징 중 하나는 우리 경제, 사회, 문화 전반에 있어서 거품이 빠지고 있다는 것이다. 거품의 제거는 이 시대의 단면을 말해주고 있는 것이지만 그것은 동시에 이 시대가 요구하고 있는 과제이기도 한 것이다.

2천년을 향한 재도약에 있어서 가장 중요한 국가경쟁력의 요소는 무엇인가? 지식재산권! 우리가 거듭나기 위해서는 이 분야에 있어서도 거품은 제거되어야 한다.

과거 우리나라의 경제발전 과정에서 기업들의 기술개발과 더불어 산업재산권 출원도 매우 활발히 이루어져 왔다. 특히 지난 93년 이후 특허 실



장완호  
〈특허청 전기심사담당관실 서기관〉

용신안의 산업재산권 출원은 연평균 16%이상의 높은 비율로 증가하였으며 지난 97년에 우리나라의 산업재산권 출원 건수는 세계 제5위를 기록했다. 그러나 과연 우리나라의 기술력도 세계 제5위의 수준일까? 그 대답은 부정적이다.

그렇게 많은 산업재산권 출원을 기록하고 있으면서 그에 상응하는 기술력을 확보하지 못하고 있는 이유는 무엇일까? 몇 년전 국내 자동

차업계에서 기업 홍보 전략의 일환으로 무분별한 출원경쟁으로 인해 이 분야의 출원을 급증시켰던 사례는 그 질문에 대한 대답을 간접적으로 시사해 주고 있다.

특허심사를 하다보면 아직도 국내기업의 출원과 외국기업 출원의 기술수준 격차를 실감하지 않을 수 없다.

양도 중요하지만 질도 중요하다. 부실한 기술, 무분별한 출원경쟁은 지양되어야 한다. 이는 기업의 특허관리 비용절감을 통한 경쟁력 향상을 위해서도 또 부실한 출원을 관리해야 하는 행정비용의 절감을 위해서도 필요하다.

그런데 기업들이 과거 부실한 기술임에도 불구하고 출원을 해왔던 주된 이유 중 하나는 특허소송 등 분쟁에 대비한 방어적 목적의 출원 때문이

었다. 올해 7월부터 시행된 공개기보제는 이러한 방어적 목적의 출원을 자제토록 하기 위해 등장한 것이다.

방어적 목적의 낮은 기술을 특허출원하기 보다는 공개기보를 통하여 공개함으로써 기업으로서 특허관리 비용을 절감하고 또한 특허권 분쟁에도 휘말리지 않고 안정적으로 사업을 할 수 있다.

특허출원에 비해 18%정도의 비용밖에 소요되지 않고 출원하는 것에 비해 공개도 빠르게 이루어진다.

공개기보의 시행, 전자검색 체제의 구축 등 특허청이 추진하고 있는 일련의 사업은 산업재산권 출원의 질 향상을 위한 정책적 노력의 일환인 것이다. 그러나 결국 기술개발의 주체는 민간 기업 또

는 개인이라는 것을 감안하면 무엇보다 기업 스스로도 건수 할당식의 출원을 지양하고 우수한 기술이 개발될 수 있는 풍토를 조성할 필요가 있다.

최근 IMF 이후 기업들의 연구개발투자가 위축되고 있다는 사실은 매우 안타깝다. 지금 아무리 배가 고프다고 해서 내년에 심을 씨앗마저 먹어치울 수는 없는 일이다. 기술개발, 산업재산권 출원은 우리 국가의 씨앗과도 같은 것이다. 어려운 때일수록 내일을 준비하는 씨앗심기를 게을리해서는 안될 것이다.

공개기보제의 시행과 더불어 부실한 출원은 줄고 우수한 출원은 늘어 2천년에는 우리나라도 거품없는 명실상부한 산업재산권 대국, 기술대국으로의 재도약이 이루어질 수 있기를 기대한다.

발특9808

신  
간  
안  
내

## 『미국특허 획득을 위한 미국특허출원서 쓰는 방법』

지식에 기반을 둔 산업사회로의 전환에 따라 지적재산권의 중요성이 날로 더해가고 있으며, 특허 기술력과 넓은 시장을 주무기로 삼고 있는 미국의 특허권 획득은 그 중요성이 크다 할 것이다.

따라서 "How to Write a Patent Application"을 번역한 본서는 미국 특허출원서의 구성서류와 이들 서류의 작성시 유의사항 등을 법원의 판례와 사례를 들어 분야별로 알기 쉽게 설명하고 있어, 특허법원 판사와 특허심판원 심판관, 특허청심사관, 변리사 및 기업체의 특허관련업무 담당자들이 미국특허출원서를 이해하는데 좋은 지침서가 될 수 있을 것이다. 본서의 구성은 제1장의 서론 및 출원시기에서부터 특허출원서 구성서류, 발명자와 공동작업, 신규성조사, 도면, 청구범위작성, 명세서 작성요령, 정보공개 진술서, 의장·식물·전기·소프트웨어·화학·생명공학 분야 특허출원서 및 외국 출원을 위한 미국출원서 준비요령 등 총 15장으로 이루어졌으며 부록으로 미국특허 및 상표출원 수수료율을 수록하였다.

<셀튼 저 (주중호 역, 연락처 568-1088(FAX:569-5016) 한지재권 연구회 발행, 5백33쪽, 실비)>